触媒 CVD 過程でのナノチューブ生成の分子動力学

Molecular Dynamics of Nanotube Nucleation in Catalytic CVD

機正 *澁田 靖(東大院学) 伝正 丸山 茂夫(東大院)

Yasushi SHIBUTA and Shigeo MARUYAMA

Dept. of Mech. Eng., The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656

The formation process of single walled carbon nanotubes (SWNTs) in CCVD method was studied with the molecular dynamics simulation. Starting from randomly distributed carbon atom and a nickel cluster, the metal-catalyzed growth of the cap-structure of SWNTs was calculated. Carbon atoms were absorbed in the metal clusters until saturated, made hexagonal network, and precipitated around the sphere surface or from the structural edge. The cap structure was obtained after continuous carbon supply. Additional supply led to the tube structure with the cap that can regard as the initial growth process of SWNTs in CCVD method.

Key Words : Molecular Dynamics Method, Carbon Nanotube, Catalytic CVD, Nucleation

1. はじめに

1993年に飯島らによって発見された単層炭素ナノチュ ーブ(SWNTs)は⁽¹⁾,その後のレーザーオーブン法⁽²⁾やアーク 放電法⁽³⁾等の選択的合成法の開発を契機に,多方面におい て研究開発が盛んに行われるようになった.ここ数年,触 媒 CVD 法⁽⁴⁾が,低コスト大量合成の突破口として注目され ているが,著者らはアルコールを炭素源とする触媒 CVD 法⁽⁵⁾により,一酸化炭素⁽⁴⁾や炭化水素⁽⁶⁾を用いる従来方法に 比べ,低温かつ高純度の SWNT 合成方法を開発した.現在 の段階では,直径やカイラリティ(巻き方)の制御には至っ ておらず,これらの実現のためには SWNT の生成メカニズ ムの解明が必至である.本研究では,古典分子動力学法の 立場から,触媒 CVD での SWNT 生成過程について詳細に 検討した.



Fig. 1 Initial condition of growth simulation.

2. 計算方法

実際の触媒 CVD 法では、炭化水素やアルコール等の炭 素源分子が、数 nm 程度の触媒金属表面で分解し、炭素原 子を供給すると考えられる.そこで、異なる分子間の炭素 間に van der Waal 力を働かせることにより、触媒金属を介 してのみ、炭素原子間に共有結合を実現できるようにし、 上記の反応過程を簡略化して取り扱った.炭素間共有結合 ポテンシャルとして Brenner ポテンシャル⁽⁷⁾を、金属炭素、 金属金属間ポテンシャルには著書らが開発した多体ポテン シャル⁽⁸⁾を用いた.異なる分子の炭素間の van der Waal 力 は Lennard-Jones ポテンシャル($\varepsilon = 2.4 \text{ meV}, \sigma = 3.37 \text{ Å}$)で表 現した.運動方程式の数値成分には修正 Verlet 法を用い、 時間刻みは 0.5 fs とした.温度制御に関しては、擬似的に 平衡条件を実現するため、系の並進、振動、回転エネルギ ーに対して、独立に Berendsen 法⁽⁹⁾($\tau = 0.17 \text{ ps}$)を施した.

始めに、面心立方格子(fcc)構造に配置した Ni₃₂, Ni₁₀₈, Ni₂₅₆を 2000 K で 2 ns アニールして触媒金属クラスターの 初期構造を決定した.得られたクラスターの直径はそれぞ れ 0.8 nm, 1.3 nm, 1.6nm であった.全方向に周期境界条 件をほどこした一辺 200 Å の立方体セルに 500 個の炭素源 分子と上記の触媒金属クラスターをランダムに配置し(図 1),制御温度 2500K で 100 ns(Ni₁₀₈のみ 130 ns)計算を行っ た.

3.計算結果と考察

図2にNi₁₀₈と炭素からなる系についての時間発展の様子 を示す.初期段階ではすべての炭素が触媒表面から取り込 まれ,金属炭素クラスター内に六員環構造を形成した.金



Fig. 2 Snapshots of metal-catalyzed growth of the cap structure after 130 ns molecular dynamics calculation at 2500K for Ni₁₀₈.



Fig. 3 Snapshots of metal-catalyzed growth of the cap structure at 2500K for Ni_{32} and Ni_{256} .



Fig. 4 Metal particles after 50 ns calculation.

属原子数の約 2 倍の炭素が取り込まれたあたりで飽和し (図 2(a)),続いてこれらが表面に析出した.その際,触媒 の曲率に沿った小さなキャップ構造が出現したり(図 2(b)), 結晶化した部分の縁から析出したりした(図 2(c)). グラフ ァイト構造が触媒表面を覆うにつれて,触媒に取り込まれ る炭素の割合が減少するが,触媒表面が残っている間は, 炭素が吸収され続けた.やがて析出した炭素同士が結合し (Fig 2(d)),触媒表面から浮いたキャップ構造となった(Fig. 2(e)),さらに炭素が取り込まれると、キャップ構造が次第 に持ち上げられた(Fig. 2(f)).これらの一連の流れより,触 媒金属の働きにより,炭素のキャップ構造が作られ,これ を核として SWNT が生成されると考えられる.この場合の キャップ構造の直径は,触媒金属の直径にほぼ一致した.

図3はNi₃₂, Ni₂₅₆の系についての時間発展の様子である. いずれの場合も初期過程は上記の Ni108の場合と同じで, す べての炭素が触媒に取り込まれ、飽和するが、Ni32ではす べての触媒表面がグラファイトに覆われてしまい、それ以 上,反応が進まなかった(図 2(a)). 一方 Ni256の場合は,触 媒表面が残っており、炭素が吸収され続け、途中で出現し たキャップ構造が持ち上げられた(図 3(b)). また Ni256 で作 られたキャップ構造は、触媒金属の部分的な結晶構造によ って決められており、図2のNi108のように、必ずしも触媒 の直径と一致するとは限らない. また図 3(c)は Ni256 系の 20 ns 時点での触媒の断面と一部分を切り出したものであ る. 触媒内で作られた六員環構造の間に金属が並んだ結晶 構造を取っている. このようなグラファイト様結晶は実験 でも観測されており(10), ニッケルとグラファイトの間に強 い相互作用があることを意味している.これより,結晶配 向性が SWNT のカイラリティの決定に影響を及ぼしてい ることが予想される.

以上の計算では、約 100ns で、ほぼすべての炭素が触媒

金属に取り込まれてしまい,キャップ構造のさらなる成長 は期待できない.そこで Ni₁₀₈の最終構造(図 2(f))を取り出 して,再び図 1 のようにランダムに配置した炭素源分子と 共に配置し,50 ns 計算を続けた.この際,炭素源分子 150 個,500 個の 2 条件で計算した.図4 にそれぞれ 50 ns 計算 した様子を示す.最適密度ではキャップ構造を維持したま ま成長を続けたが,より高い密度を与えた場合は,すべて の触媒表面が覆われてしまった.このような傾向は著者ら の最近の実験において,炭素源の圧力が高すぎるとグラフ ァイトが触媒金属を覆われた,いわゆる"ナノオニオン" が生成されること⁽¹¹⁾と矛盾しない.よって SWNT 生成には 触媒のサイズのみならず,触媒に炭素を供給する割合にも 大きく影響されることが定性的に示された.

4.まとめ

古典分子動力学法シミュレーションによって触媒金属ク ラスターと炭素源分子が反応して、SWNTのキャップ構造 を生成し、成長していく過程を再現した.これらの結果よ り、触媒 CVD 過程での SWNT 生成メカニズムについて考 察する.アルコールや炭化水素などの炭素源分子は触媒表 面で炭素に分解され、触媒に取り込まれ、金属炭素合金と なる.やがて炭素が飽和すると、グラファイト構造を形成 しながら表面から析出してくる.この際、曲率をもった触 媒表面に沿う場合と結晶の端から析出する場合がある.こ れらの量が増えてくると、キャップ構造に進化し、この際、 グラファイトに覆われていない触媒表面が残っていると、 そこから炭素がさらに取り込まれてキャップ構造が持ち上 げられ、SWNTへと成長すると考えられる.

5. 参考文献

[1] S. Iijima et al., Nature, 363 (1993), 603. [2] A. Thess et al., Science, 273 (1996), 483. [3] C. Journet et al., Nature, 388 (1997), 756. [4] H. Dai et al., Chem. Phys. Lett., 260 (1996), 471. [5] S. Maruyama et al., Chem. Phys. Lett., 360 (2002), 229. [6] J. Kong et al., Chem. Phys. Lett., 292 (1998), 567. [7] D. W. Brenner, Phys. Rev. B, 42, 9458 (1990). [8] Y. Yamaguchi et al., Euro. Phys. J. D, 9 (1999), 385. [9] H.J.C. Berendsen et al., J. Chem. Phys. 81 (1984), 3684. [10] F. Banhart et al., Phys. Rev. Lett., 84 (2000), 686. [11] Y. Murakami, et al., Chem. Phys. Lett, submitted.